

приятия, научные организации, средства массовой информации, занимающиеся проблемами нанотехнологий, принять активное участие в работе выставочно-конгрессного мероприятия.

Затем члены Президиума (Аслаханов А. А., Алексенко А. Г., Серебряников С. В., Вернер О. Э.) и присутствующие в зале специалисты (заместитель

директора ФГУП СНПО "Элерон" Долгополов Н. В., председатель Совета директоров НПО "Синтетика-Строй" Мороз В. В., генеральный директор "НТЦ Прикладных нанотехнологий" Пономарев А. Н. и другие) ответили на многочисленные вопросы журналистов.

<http://www.b95.ru/>

CONTENTS

Adamov Yu. F., Gorshkova N. M., Matveenko O. S. <i>Silicon Heterostructure for Nanoscale Transistors</i>	4
Abramov I. I. <i>Problems and Principles of Physics and Simulation of Micro- and Nanoelectronics Devices. VI. Single-Electron Structures.</i>	10
Samoylovich M. I., Belyanin A. F., Illyushechkin A. Yu. <i>Properties and Structure Peculiarities of High-Temperature Superconducting Films</i>	25
Pecherskaya E. A. <i>Metrological Aspects of an Active Dielectrics' for Micro- and Nanoindustry</i>	41
Kosushkin V. G., Adarchin S. A., Maximova E. A. <i>Description of Stress Effect on Charge Carrier Concentration by Microthermo-EMF Measuring Procedure</i>	45
Lubimsky V. M. <i>Comparison of Deflections of the Centers of a Circle and of a Square Diaphragms, Calculated in Nonlinear Approach by Various Methods and Specification of Criterion of Applicability of the Linear Theory at Accounts of Deflections and Deformations of a Square Diaphragms</i>	46
Raspopov V. Ya., Ivanov Yu. V., Orlov V. A. <i>Analysis of Noise into Micromechanical Gyroscopes</i>	51
Godoviztin I. V., Fedorov R. A., Chaplygin Yu. A. <i>Capacitive Pressure Transducer by Surface Micromachining</i>	54
Timoshenkov S. P., Zhukov A. A., Zakharov A. A. <i>Bimorph Actuator Based on a Polyimide V-Groove Joints</i>	60
Solov'yev Yu. V., Yolkov V. V., Aleksandrov S. E., Speshilova A. B. <i>Electrostatically Ohmic-Capacitive MEMS Switch</i>	65
Mefedova Yu. A., Vlasov V. V., Vlasov A. V. <i>Use of Magnetic Fluids in a Basis of Sensing Devices of Electrohydraulic Devices</i>	68
Puriy A. V., Baturin A. S., Sheshin E. P., Sherstnev P. V. <i>Quantitative Calibration of Magnetic Force Microscopy Tips by Using Current-Carrying Wires</i>	70

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: nmst@znet.ru; http://www.microsystems.ru

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@znet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор И. С. Павлова. Корректор Е. В. Комиссарова

Сдано в набор 18.05.2007. Подписано в печать 22.06.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,92. Заказ 901. Цена договорная

Отпечатано в Подольской типографии — филиал ОАО "ЧПК", 142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15